



МАЛОГАБАРИТНАЯ УСТАНОВКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПЛАСТИН И МАТЕРИАЛОВ В ВАКУУМЕ ИЛИ В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ

ОТЖИГ ТМ-5

Назначение:

Автоматизированная термическая обработка кремниевых пластин, керамических подложек и материалов (отжиг, сушка, разгонка диффузанта, восстановление кристаллических структур и др.) в высоком вакууме или в газовой среде.

Особенности:

- Групповая обработка 25 пластин до $\varnothing 100$ мм или керамических подложек;
- Кварцевый реактор с герметизируемой рабочей зоной;
- Диапазон рабочих температур 300-700 °С;
- Рабочие газы: Ar, H₂, N₂, O₂;
- Повышенная скорость нагрева и охлаждения;
- Микропроцессорная система управления;
- Безмасляная система откачки (ТМН 300);
- Мощность потребления не более 5кВт;
- Возможность встраивания в «чистую комнату»;
- Площадь, занимаемая одной установкой ~ 1,2 м².

